Espacenet Bibliographic data: TW446687 (B) ___ 2001-07-21

Method and apparatus for producing ultra pure water

ABE MITSUGU [JP]; CHINO SHUICHI [JP]; NAKAMURA Inventor(s):

YUTAKA [JP]; KOGURE MASAHIKO [JP] *

Applicant(s): NOMURA MICRO SCIENCE KK [JP] &

C02F1/32; C02F1/42; (IPC1-

international: 7): C02F1/32; C02F1/42 Classification:

> - European: C02F1/32; C02F1/42

Application number:

TW19970102030 19970220

Priority number

(s):

JP19960031907 19960220

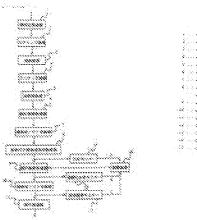
Also published

WO9730939 (A1) JP2008173637 (A) JP4294731

(82)

Abstract of TW446687 (B)

The present method and apparatus for producing ultra pure water comprises the steps of: irradiating ultraviolet rays to water to be treated to form the first treated water, performing ion-exchange treatment. on the first treated water to form the second treated water, wherein the quantity of the ultraviolet rays to be irradiated is determined based on the result of measurement of a TOC concentration of the water to be treated.



erroment on himself street visite income accesses

申請日期 86

第 86102030 號專利申請案

中文說明書修正頁

民國 89 年 10 月修正

申請日期 86 年 2 月 20 日 案 號 86102030 類 別 Cu 2 F 1/3 2 / 42 F AZ

446687

()	以上各欄由	本局填註)	446687
	多	参明 專利 説 明 并型	書
發明	中文	超純水製造方法及超純水製造裝置	
一、	英 文	Method and apparatus for propure water.	oducing ultra
	姓名	(1) 阿部嗣 ② 知野秀一 (3) 中村穣	
、養明 二、 <u>★#</u> #人	國 籍	(1) 日本 ② 日本 (1) 日本國厚木市岡田二-九-八	(3) 日本
	住、居所	② 日本國厚木市岡田二一九一八	
		(3) 日本國厚木市岡田二一九一八	
-	姓 名 (名稱)	(1) 野村微科學股份有限公司 野村マイクロ・サイエンス株式会	≧社
	國籍	(1) 日本	
三、申請人	住、居所 (事務所)	(1) 日本國神奈川縣厚木市岡田二丁目	目九番八號
	代表人姓 名	(1) 佐藤久雄	
	:	• ·	

#	請日期	86	年	2	月	20	日	
案	號		861	0203	0			
類	81	·						

C4

()	以上各欄由	1本局填註)
	<i>i</i>	發明專利說明書
一、發明 一、************************************	中文	
· 新型	英文	
	姓名	40 木暮雅彦
二、發明人	國 籍	40 日本 (4) 日本國厚木市岡田二-九-八
制作	住、居所	
	姓 名 (名稱)	
	國籍	
三、申請人	住、居所 (事務所)	
	代表人姓 名	

(由本局 類: 大類: 1PC分類:

A6 B6

			
本案已向:			
國(地區)	申請專利,申請日期:	案號:	,□有 □無主張優先權
日本	1996 年 2 月 20 日	8 - 31907	☑有主張優先權
		•	
有關微生物已寄存於	: ,寄存日期	90 :	,寄存號碼:

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

五、發明説明(1)

本發明係有關,製造能廣泛運用於製造液晶或半導體的電子工業,原子能發電所或醫藥品製造工場等之超純水的製造方法及超純水製造裝置。

目前使用於液晶或半導體元件(LSI),醫藥品之製造過程中的超純水爲,含有極少量之離子狀物質,微粒子,有機物,溶存氣體及生菌等的超純水。但,尤其是電子工業上,隨著對LSI之集成度的增加,因此,對超純水之純度的要求也就更加嚴苛,其中,又以能同時降低超純水中之溶存氣體及有機物爲重要課題。具體而言,例如,製造16M之DRAM時超純水需爲,全有機碳濃度(TOC)5ppb以下之超純水。又,製造64M及256M之DRAM時超純水需爲,全有機碳濃度(TOC)及溶存氣濃度(DO)10ppb以下之超純水。又,製造64M及256M之DRAM時超純水需爲,全有機碳濃度(TOC)及溶存氣濃度(DO)均1ppb以下之超純水(THEODOKE H. MELTZER; HIGH-PURITY WATER PREPARATION TALL OAKS PUBLISHING INC.)。

一般製造超純水之方式係由,先去除原水中之濁質成分的前處理系統與,去除離子狀物質,微粒子,有機物,溶存氣體及生菌等之一次系系統與,以使一次系系統所得之一次純水更精製爲目的的二次系系統組合而成的。

已知的去除被處理水中所溶存之有機物的方法有,對被處理水照射具有185nm波長之紫外線,再將臭氧加入被處理水中的以185nm波長之紫外線照射的方法(Robert A. Governal, Farhang Shadman; WATER TECH E-

五、發明説明(2)

XPO, 1991)。此方法雖能有效地分解被處理水中腐殖酸 等 所 代 表 之 髙 分 子 ・ 但 , 將 臭 氧 加 入 被 處 理 水 中 時 會 因 臭 氧 而 產 生 過 氧 化 氫 , 故 會 使 被 處 理 水 中 的 溶 存 氧 濃 度 (D O) 上升。至於利用照射紫外線去除被處理水中的溶存 有機物時,爲了能促進紫外線分解有機物,而以過氧化氫 爲氧化補助劑並將其加入被處理水中的方法,則需由被處 理水中去除過剩的過氧化氫。又,由被處理水中去除過氧 化氫的方法有,使用活性碳或使用陰離子交換樹脂的方法 (特開平5-300號公報),但,這些方法的被處理水 中之過氧化氫濃度多半很高,又,易使被處理水污染,因 此,很難被使用於爲了使一次純水更精製的二次系系統中 。 另 外 , 爲 了 使 被 處 理 水 中 所 含 有 的 有 機 物 濃 度 爲 1 0 0 p p b 以下之低濃度,以促進紫外線分解有機物,故有將 被處理水中之溶存氧濃度調整爲10~100ppb的方 法 (特 開 平 4 - 4 0 2 9 2 號 公 報) 。 但 , 爲 了 使 , 處 理 水之溶存氧濃度爲1 p p b 以下時,必需調整與溶存氧濃 度 有 關 的 被 處 理 水 中 之 有 機 物 濃 度 或 種 類 , 因 此 , 實 際 上 係很難實行的。

而能使一次純水更精製的二次系系統中之,能減少超純水中之有機物濃度的處理方法有利用紫外線照射經離子交換處理過或逆浸透法之膜處理過的一次純水,以分解所含有之有機物,接著,利用混床式離子交換塔去除所分解的有機物之方法。又,已知利用於照射被處理水之一次純水的紫外線爲,具有180~190nm(特別是

五、發明説明(3)

184.9 n m)波長的紫外線,其能有效率地達成分解所含有之有機物(特開平1-164488號公報)。即,於一次系系統中幾乎能完全去除來自原水中的有機物,而由一次系系統中泄漏的有機物爲,分子量係數百以下之比較低分子的有機物,数波長185nm之紫外線能充分分解此有機物(美國專利第5573662號)。

但,利用具有能產生180~190 n m 波長之紫外線的紫外線照射裝置及拋光器裝置(混床式離子交換塔)之二次系系統,以處理經一次系系統而將有機物濃度減至極低濃度之被處理水的一次純水時會造成,通過拋光器裝置(混床式離子交換塔)之被處理水中的溶存氧濃度比未經二次系系統處理過之一次純水的高。

即,利用目前的二次系系統處理經一次系系統而使有機物濃度減至極低濃度之一次純水時會有,所得之超純水中溶存氣濃度明顯增加的問題。

另外,如一次純水般,為了能於被處理水之全部有機碳濃度(TOC)為100ppb以下,溶存氧濃度為1ppb之低濃度時,於不會因照射紫外線使溶存氧濃度上升之情形下去除有機物,而有將紫外線照射前之被處理水保持一定全有機碳濃度的方法(特開平8-10758號公報)。但,利用添加有機物等方式係很難將被處理水之全有機碳濃度控制於一定值,又,會使成本明顯增加。至於特開平7-16580號公報則揭示,於紫外線照射裝置之後段設置還原性樹脂,以降低處理水中之溶存氧濃度

五、發明説明(4)

的方法,但,設置還原性樹脂會使成本增加,且有還原性樹脂所造成的處理水被污染之問題。又,以二次系系統處理超純水時往往會將不純物加入處理水中,因此,所使用的會產生不純物之可能性高的單位機器較好爲不純物量少者。

爲了解決上述各問題,故本發明之目的爲,提供一種能於經濟上防止超純水之溶存氣濃度增加,且可實現降低全有機碳濃度(TOC)的超純水製造方法及超純水製造裝置。

如上述般,以目前的二次系系統處理經一次系系統而得到的有機物濃度極低之一次純水時,通過混床式離子交換塔之被處理水中的溶存氧濃度會比未經二次系系統處理前之一次純水的大很多。

於是本發明者們針對此問題專心檢討後發現,利用紫外線照射裝置對有機物濃度已減至極低之一次純水,照射波長爲180~190nm之紫外線,特別是具有184.9之波長最大值的紫外線時,會由此紫外線照射

裝置之出口泄漏出微量的過氧化氫(H₂O₂)。而生成此微量之過氧化氫的機構則如下列所逃般,即,因水之紫外線分解而生成的OH自由基(羥基自由基)不會與一次純水中的微量有機物反應,而係由OH自由基們自行反應所生成。

 $H_2O + h \nu \rightarrow \cdot O H$

五、發明説明(5)

 \cdot O H \cdot O H \rightarrow H $_2$ O $_2$

即,於被處理水中幾乎不存在已分解的溶存有機物之情形下,過剩的〇H自由基們會自行反應生成過氧化氫。又,泄漏的部分之過氧化氫會於離子交換塔內部的離子交換協能表面附近分解成氧及水,因此,通過離子交換塔之被處理水中的溶存氧濃度會比未經二次系系統處理之一次純水的大。

因此,本發明之第1發明係有關超純水製造方法,其特徵係具備,測定被處理水中之全有機碳濃度的步驟及,以所測得之全有機碳濃度為基準來決定照射被處理水之紫外線照射量的步驟及,以所決定之照射量照射被處理水而生成第1處理水之步驟及,對所生成之第1處理水進行離子交換以生成第2處理水之步驟。

又, 本發明之第2發明係有關超純水製造方法, 其特

五、發明説明(6)

徵係具備,以紫外線照射被處理水而生成第1處理水之步驟及,對所生成成之第1處理水進行離子交換以生成第2處理水的步驟及,依據(1)前述被處理水中之全有機碳濃度與(2)前述第1處理水中之過氧化氫濃度及/或第2處理水中之溶存氧濃度來決定照射前述被處理水之紫外線照射量的步驟。

決定照射被處理水之紫外線的最適照射量時,雖只需測定被處理水中之全有機碳濃度,第1處理水中之過氧化氫濃度,第2處理水中之溶存氧濃度等三要件中的被處理水中之全有機碳濃度即可,但,前述要件中若能測得複數或可能全部時,除了可確認對應被處理水中之全有機碳濃度而照射最適照射量之紫外線外,還可確實進行各項步驟之異常現象的監視等工作。

第1發明之超純水製造方法中的依據所測得之被處理

五、發明説明(7)

至於爲了決定對被處理水之紫外線照射量而測定複數的被處理水中之了OC,第1處理水中之過氧化氫。決定對於中之過氧化氫。決定對於中之時形下,首先需設定之類定結果的優先順序,若全部測定結果的優先順身量和,與與與人之類是相同時,就以與照射量不同時,與與與人之類是結果所決定之類,與則是結果爲基準決定照射被處理水中之際,第1處理水中之際存氧濃度時,與

五、發明説明(8)

就本發明之第1及第2發明的超純水製造方法而言,照射被處理水之紫外線最適照射量可依對象的被處理水性狀而作適當設定。即,一般而言被處理水中之全有機碳費,成分及成分比等可因地域或被處理水的用途而與,使處理水係作爲洗淨半導體用之再循環水時,被處理中的有機物有醇類等。因此,不可一味地決定照射被處理水之紫外線最適照射量,而需針對每個不同對象之被處理水設定最適照射量。

又,第1及第2發明之超純水製造方法中的照射所決定之紫外線照射量的方式並無特別限制,例如可使用,使部分的能產生紫外線之紫外線照射裝置內所裝備的複數之紫外線燈管熄燈的方法。若所配置之紫外線照射裝置為複數時,亦可使用將紫外線照射裝置之台數分割爲隨意的比率而沿著流動路線依序設置,再使任何一個紫外線照射裝

装

訂

五、發明説明(g)

置群熄燈的方法。另外,當紫外線照射裝置內之紫外線燈管的點燈電源爲,裝備高周波電子安定器的高周波電源時,則可利用增加或減少高周波電源之周波數,以調節所產生的紫外線照射量。除了前述各種方法外,亦可爲任何的能控制照射量之方法,並無特別限制。

本發明之第 1 及第 2 發明的超純水製造方法中所使用的照射被處理水之紫外線可爲,若具有 1 8 0 ~ 1 9 0 n m ,尤其是 1 8 4 . 9 n m 之波長的紫外線時,可同時產生具有殺菌波長之 2 5 4 n m 的紫外線 氧 化用低壓 外線 置雖無特別限制,但以使用紫外線氧化用低壓紫外線燈管爲佳。因此紫外線而起的反應則如下,(1)利用線燈管爲佳。因此紫外線而起的反應則如下,(1)利用一次純水所生成的 0 H 自由基(羥基自由基),(2 的機能建水之一次純水中的有機物氧化分解爲羧酸等有機酸之階段,(3)再將部分的有機酸氧化分解成二氧化碳。

- (1) $H_2O + h \nu \rightarrow \cdot O H$
- $(2) R C + \cdot O H \rightarrow R C O O H$
- (3) R C O O H + \cdot O H \rightarrow C O $_2$ + H $_2$ O

又,如一次純水般,若被處理水中存在著微量之溶存 有機物時,會如(4)所示般因OH自由基們之反應而同 時產生過氧化氫。(4)・OH+・OH→H₂O₂

因本發明之第 1 及第 2 發明的超純水製造方法係利用,分解被處理水中之全有機碳濃度以生成最適量的羥基自

五、發明説明(10)

本發明之第1及第2發明的超純水製造方法中照射紫外線之對象的被處理水,就能充分發揮因紫外線而產生的被處理中之有機物分解能及,能確實壓制過氧化氫產生之觀點而言較好爲,全有機碳濃度(TOC)係500 ppb以下,又以100ppb以下爲佳者。

本發明之第3發明係有關超純水製造裝置,其特徵係具備,測定被處理水中之全有機碳濃度的手段及,依據所測得之全有機碳濃度來決定照射被處理水的紫外線照射量之手段及,以所決定之照射量照射被處理水而生成第1處理水的手段及,對所生成之第1處理水進行離子交換以生成第2處理水之手段。

利用本發明之第3發明的超純水製造裝置,再依據被處理水中之全有機碳濃度,以能使泄漏至第1處理水中之過氧化氫成爲最小般的方式來控制照射被處理水之紫外線照射量時,則可於不使來自第1處理水之溶存氧濃度上升的情況下進行離子交換,故易於製造出能大大降低全有機

五、發明説明(11)

碳濃度及溶存氧濃度的超純水。

本發明之第4發明係有關超純水製造裝置,其特徵係具備,對被處理水照射紫外線以生成第1處理水之手段及,對所生成之第1處理水進行離子交換以生成第2處理水的手段及,依據(1)被處理水中之全有機碳濃度,(2)第1處理水中之過氧化氫濃度與/或第2處理水中之溶存氧濃度來決定照射被處理水之紫外線照射量的手段。

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁

利用本發明之第4發明的超純水製造裝置,再依據(1)被處理水中之全有機碳濃度,(2)第1處理水中之過氧化氫濃度及/或第2處理水中的溶存氧濃度,以能使泄漏至第1處理水中之過氧化氫量成爲最小般的方式來控制照射被處理水之紫外線照射量時,則可於不使來自第1處理水之溶存氧濃上升的情形下進行離子交換,故易於製造出能大大降低全有機碳濃度及溶存氧濃度的超純水。

至於本發明之第3及第4發明的超純水製造裝置中所使用的測定被處理水中之全有機碳濃度者,並無限制,其中之以使用一般用的了0℃測定器較爲合適。又,第4發明之超經水中之內類定器的手段可與如果水中之內類定第1處理水中之內類定第1處理水中之過氧化氫濃度及第2處理水中之過氧化氫濃度及第2處理水中之氫濃度及第2處理水中之氫濃度及第2處理水中之氫濃度形化機份濃度及(2)第1

五、發明説明(12)

處理水中之過氧化氫濃度及/或第2處理水中之溶存氧濃度而決定照射被處理水之紫外線照射量的手段可爲,具備以各個測定結果爲基準,以能使泄漏至第1處理水中之過氧化氫量成爲最小般的方式來決定照射被處理水之紫外線最適照射量的方法者,並無限制。

又,對所生成之第1處理水進行離子交換以生成第2處理水的手段較好爲,使用填充有強鹼性陰離子交換樹脂及陽離子交換樹脂的非再生型混床式離子交換塔。又換機間,第1處理水進行離子交換所使用的部材亦可爲,離子交換膜。至於離子交換塔中所使用的離子交換機間較好爲,新品之無破碎,離子交換機間或解子交換膜亦較好爲,離子交換性能高且不會溶出不純物者。

五、發明説明(13)

若利用本發明之第 1 及第 2 發明的超純水製造方法與,第 3 及第 4 發明之超純水製造裝置,則可將第 2 處理水中之溶存氧濃度降至 1 p p b 以下及,將全有機碳濃度(T O C) 減至 1 p p b 以下。

下面將參照圖表詳細說明本發明之實施形態。但,非限於此實施形態。

(實施例1及比較例)

圖 1 爲,本發明的超純水製造裝置之一的構造圖。

就圖1而言係將原水導入膜前處理裝置1(野村微·科學股份公司; NML-E20HS4)以分離,去除原水中之懸浮物質。其次,利用陽離子交換塔2(野村微·科學股份公司; #200C-C),脫碳酸塔3(野村微·科學股份公司; NDG-15)及陰離子交換路4(野村微·科學股份公司; #200A-C)等2床3路以去除經膜前處理裝置1處理過之被處理水中的離子成分安除經膜前處理裝置1處理過之被處理水中的離子成分表除經膜前處理裝置1歲2後置5(東連股份有限公司; SU-710),以去除微粒子及膠態狀物質等。

其後,將被處理水由逆浸透裝置 5 導入第 1 紫外線照射裝置 6 (野村微·科學股份公司: N N U V - 1 0 4) 以分解溶存有機物後,再利用混床式離子交換塔 7 (野村微·科學股份公司: # 2 0 0 M - A) 去除被處理水中的離子成分。其後,將被處理水導入添加氦氣方式之真空脫氧塔 8 (美國專利第 5 1 8 0 4 0 3 號)中,以去除溶存

ズ

訂

五、發明說明(14) 氧等溶存氣體。

接著,將被處理水導入紫外線照射裝置 9 (野村微·科學股份公司; N N U V - 1 0 4 之改良型)以分解溶存有機物,而生成第 1 處理水,其後,將第 1 處理水導入混床式離子交換塔 1 0 (野村微·科學股份公司;

#200M-A)以去除被處理水中的離子成分,而生成第2處理水。

最後將第2處理水導入超過濾膜111(日東電工股份公司; NTU-3306 K4R)以去除極微量之微粒子等。至於真空脫氧塔8的直徑爲250mm,填充高度爲2m,氮氣與被處理水之體積比率爲0.03:1,病 空度保持爲25torr。又,區分膜前處理裝置1爲前處理系統,陽離子交換塔2至真空脫氧塔8爲一次系系統,紫外線照射裝置9至超過濾膜11爲二次系系統。

罗外,此超純水製造裝置係,將來自於添加氦氣型真空脫氧塔8之出口的TOC監視器12(安那鐵(Anatel)股份公司;A-10000)之TOC濃度信號A及,來自於第2低壓紫外線燈管氧化裝置9之出口的過氧化氫點視器13(電氣化學計器股份公司;(HP-0003)之出與簡響和類數量,來自於拋力器裝置10之出與的溶存氧點視器14之溶存氧濃度信號CD的置的溶存氧點視器14之溶存氧濃度信號CD的置

五、發明説明(15)

照射量,而控制紫外線照射裝置 9 中的低壓紫外線燈管的點燈數。

又,最適照射量則如圖 2 所示般,下面將詳述紫外線 之最適照射量的決定方法。

將來自TOC監視器12之TOC信號A及,過氧化氫監視器13之過氧化氫濃度信號B及,溶存氧監視器14之溶存氧濃度信號C輸入控制裝置15後,再將TOC信號A,過氧化氫濃度信號B及溶存氧濃度信號C之測定結果參照最適照射量表的測定結果,而選擇出符合的表號碼。

其次,比較所選出的表號碼之優先順序,再依據優先順序中的前者之表號碼來決定紫外線燈管的點燈狀態。

例如,來自TOC監視器12之TOC信號A爲4ppb,過氧化氫監視器13之過氧化氫濃度信號B爲10.02ppm,溶存氧監視器14之溶存氧濃度信號C爲60分以上0.4ppb時,所選出的表號碼有1,3,6,再依據其中最優先之表號碼3來決定紫外線燈管的點燈狀態。即,此時所決定的紫外線照射量爲,比現時點的減少25%。接著,依據此決定而由控制裝置15將信號送給第2低壓紫外線燈管氧化裝置9,以控制低紫外線燈管之點燈數。

若此超純水製造裝置中之測定結果所符合的表號碼爲 1個,或不存在時,紫外線燈管之點燈狀態則維持現狀, 又,符合測定結果之表號碼爲2個時,則依據兩者中優先

ズ

訂

五、發明説明(16)

順序前者之表號碼來決定紫外線燈管的點燈狀態。又,依據來自了OC監視器12之了OC信號A,過氧化氫監視器13之過氧化氫濃度信號B,溶存氧監視器14之溶存氧濃度信號C的情形下卻無法決定紫外線燈管的點燈狀態時(例如,超出紫外線照射隻置9之紫外線燈管的容許照射量,而無法增加紫外線照射量時),則視爲異常現象,此時需向外發出警報。

因此,利用上述般構造之超純水製造裝置可連續製造超純水(實施例1)。又,此超純水製造裝置之運轉開始時的紫外線照射裝置9之紫外線燈管點燈率爲100%。

圖 3 爲,實施例 1 之混床式離子交換塔 1 0 的出口之溶存氧 濃度與,紫外線照射裝置 9 的低壓紫外線燈管點燈率之關係的經時追蹤之結果。

另外,於不需由控制裝置 1 5 控制第 2 紫外線照射裝置 9 之情形下,將紫外線照射裝置 9 之低壓紫外線燈管一直維持爲 1 0 0 %點燈率,以製造超純水(比較例)。

圖 4 爲,上述比較例之混床式離子交換塔 1 0 的出口之溶存氧 濃度與,紫外線照射裝置 9 的低壓紫外線燈管點燈率之關係的經時追蹤之結果。

由圖 3 得知,實施例 1 幾乎抑制了溶存氧濃度的變動及,將溶存氧濃度維持於 1 p p b 以下。又,由圖 4 得知,比較例中溶存氧濃度之變動性比實施例 1 大,且無法將溶存氧濃度維持於 1 p p b 以下。

其原因為,實施例1因使紫外線照射裝置9之紫外線

五、發明説明(17)

照射量最適當化,故被處理水之紫外線分解而生成的〇H自由基量低於能與被處理水中之有機物反應的量,故被處理水中之有機物反應的量,故被處理水中之紫外線照射量。故被與實力。如此與對量,以上之量,以上之量,與與 60 日中之,與 60 日中之,以上之量, 70 內之離子交換樹脂表面附近,分解成氣及水而生成氣。

(實施例2)

圖5爲,本發明的超純水製造裝置之另一構造圖。

五、發明説明(18)

信號 A 實時輸入控制裝置 1 5 後,再由控制裝置 1 5 依據所輸入之下 0 C 濃度信號 A 來決定最適照射量,以控制裝置 6 稅 稅 線 照射量,以外線 照射裝置 9 之低壓紫外線 燈管點 燈數。除前述外,實施例 2 之超純水製造裝置的其他構造同實施例 1。因地域。因地域。因地域。因此,故是有機碳濃度,成成及成分。因地域外線。面與射量。實施例 2 則係利用圖 5 所示之超純水製造器 0 競照射量。實施例 2 則係利用圖 5 所示之超純水製造裝置,以厚木市水為原水而設定照射被處理水之紫外線透照射量。

五、發明説明(19)

接著,於處理水中加入異丙醇,以變動處理水中之全 有機碳濃度(T O C) , 再決定處理水中之各個全有機碳 濃度的最適合之紫外線照射裝置6及9的輸出功率。又, 於處理水中加入異丙醇的目的係使紫外線裝置 6 之入口的 被處理水中之全有機碳濃度爲 5 ~ 7 p p b , 7 ~ 1 0 p p b , 1 0 ~ 1 5 p p b 。其結果如圖 8 所示。即,當 紫外線照射裝置6之入口處的被處理水中之全有機碳濃度 爲5~7ppb,7~10ppb,10~15ppb時 ,可利用將紫外線照射裝置6及9之輸出功率分別控制於 6 3 % , 8 0 % , 1 0 0 % 的方式 , 將處理水中之全有機 碳 濃 度 (T O C) 及 溶 存 氧 濃 度 (D O) 保 持 於 低 濃 度 狀 態。即,對應被處理水之全有機碳濃度利用適當的紫外線 之情形下,能將處理水中之全有機碳濃度(TОС)及溶 存 氧 濃 度 (D 〇) 控 制 於 1 p p b 以 下 , 且 可 抑 制 電 力 的 消耗。而控制裝置15則依據由圖8所示之結果而作成的 最適照射量表以控制對被處理水之紫外線照射量,因此, 處理水中之全有機碳濃度(TОС)及溶存氧濃度(DО) 能 保 持 於 1 p p b 以 下 。 又 , 耗 電 方 面 亦 比 紫 外 線 照 射 裝置6及9之輸出功率維持在100%時大大的減少。

由上述內容得知,因本發明之第 1 發明的超純水製造方法係,先測定被處理水中之全有機碳 濃度 (T O C) ,再依據所測得結果來決定照射被處理水之最適當化照射量,因此,以紫外線照射被處理水時幾乎能防止過氧化氫的產生,故幾乎能抑制以過氧化氫爲起因的氧之產生,而幾

液

訂

五、發明説明(20)

乎能防止超純水中之溶存氧濃度的增加。又,能確實有效 地分解被處理水中之有機物。因此發明係依據所測得之結 果來決定照射被處理水之最適當化照射量,故紫外線之照 射量可常維持於最小,因此,此發明可提供一種經濟性優 之,能得到溶存氧濃度及全有機碳濃度(TOC)低之超 純水的超純水製造方法。

又,因本發明之第2發明的超純水製造方法係,(2) 第1被處理水中之全有機碳濃度(TOC),中之溶 類度及/或第2處理水中之過數度及/或第2處理水中之過數度及/或第2處理水水之 類度,再依據所測得之結果來決定照射被處理水時幾 類最適當化照射量,故以紫外線照射制以為類型水時幾 類似此過氧化。因此,緩與明射制以為存機物。 對於此過氧之產生,可防此超純水中之溶積物。 因此,能確實有效地分解被處理水中的有機物。 因此,能確實有效地水中的有機物。 因此,能力與一次,能過度因此 的一種經濟性優之,能得到溶存 類別。 其一種經濟性優之,能得到溶存 類。 其一種經濟性優之,能得到溶存 有機碳濃度(TOC) 低之超純水的超純水製造方法。

因本發明之第 3 發明的超純水製造裝置係,依據被處理水中之全有機碳濃度來控制照射被處理水之紫外線照射量,使其泄漏至第 1 處理水中之過氧化氫成爲最小,故能於不使來自第 1 處理水之溶存氧濃度上升的情形下進行離子交換。又,能確實有效地分解被處理水中之有機物,因此發明係依據所測得之結果來決定照射被處理水之紫外線

五、發明説明(21)

的最適當化照射量,故能將紫外線之照射量維持於最小。因此,此發明能提供一種可容易且經濟之,能得到大大降低全有機碳濃度及溶存氧濃度之超純水的超純水製造裝置。

因本發明之第4發明的超純水製造裝置係,依據(1)被處理水中之全有機碳濃度,(2)第1處理水中之過氧度來控制照數量,使其潛量。 第1處理水中之 為 濃度來控制 是 處理水中之 溶 存 氧 濃度 理 水中之 海 是 選 是 要 水中之 海 是 要 不 使 來 自 第 1 處 理 水中 之 氧 邊 理 水中 之 衛 費 和 水 存 解 的 景 的 情 形 下 進 行 離 子 交 換 。 又 , 能 確 實 有 效 地 分 定 是 是 里 水 之 有 機 物 。 因 此 發 明 係 依 據 所 測 得 之 結 果 來 此 晚 處 理 水 之 有 機 物 。 因 此 發 明 係 依 據 所 測 得 足 起 來 此 晚 報 的 最 適 當 化 照 射 量 能 常 保 最 小 。 经 明 能 提 供 一 種 容 易 且 經 濟 之 , 能 得 到 大 大 降 低 全 有 機 碳 費 及 溶 存 氧 濃 度 之 超 純 水 的 超 純 水 製 造 裝 置 。

(圖面之簡單說明)

圖 1 爲 , 本 發 明 之 超 純 水 製 造 裝 置 之 一 的 構 造 圖 。

圖 2 爲 , 設 置 於 控 制 裝 置 內 的 最 適 照 射 量 表 之 一 例 。

圖3爲,實施例1中的混床式離子交換塔10之出口的溶存氧濃度與,紫外線照射裝置9的低壓紫外線燈管點燈率之關係的經時追蹤之結果圖。

圖 4 爲,比較例中的混床式離子交換塔 1 0 之出口的溶存氧 濃度與,紫外線照射裝置 9 的低壓紫外線燈管點燈率之關係的經時追蹤之結果圖。

五、發明説明(22)

圖 5 爲, 本發明的超純水製造裝置之另一構造圖。

圖 6 爲,以厚木市爲原水之,利用實施例 2 之超純水製造裝置製造超純水時,由真空脫氧塔 8 ,混床式離子交換塔 7 ,紫外線照射裝置 9 及混床式離子交換塔 1 0 之各出口所測得的全有機碳濃度(TOC)之結果圖。

圖 7 爲,以厚木市水爲原水之,利用實施例 2 之超純水製造裝置製造超純水時,由真空脫氧塔 8 ,混床式離子交換塔 7 ,紫外線照射裝置 9 及混床式離子交換塔 1 0 之各出口所測得的溶存氧濃度(DC)之結果圖。

圖 8 爲 , 處 理 水 中 的 各 個 全 有 機 碳 濃 度 下 之 紫 外 線 照 射 裝 置 6 及 紫 外 線 照 射 裝 置 9 的 最 適 輸 出 功 率 圖。

圖 9 爲 , 紫 外 線 照 射 裝 置 的 紫 外 線 照 射 量 與 消 耗 電 力 之 關 係 圖 。

四、中文發明摘要(發明之名稱:

超純水製造方法及超純水製造裝置本發明係有關一種以紫外線照射被處理水而生成第1處理水,再對第1處理水進行離子交換,以生成第2處理水的超純水製造方法及超純水製造裝置,其中,至少需測定被處理水中的TOC濃度,再依據所測得之結果來決定照射被處理水的紫外線照射量,再以此紫外線照射量照射被處理水的超純水製造方法及超純水製造裝置。

89, 10, 2**3**

英文發明摘奏(發明之名稱:Method and apparatus for producing ultra pure water.

The present method and apparatus for producing ultra pure water comprises the steps of:

irradiating ultraviolet rays to water to be treated to form the first treated water.

performing ion-exchange treatment on the first treated water to form the second treated water.

wherein the quantity of the ultraviolet rays to be irradiated is determined based on the result of measurement of a TOC concentration of the water to be treated."

六、申請專利範圍

第86102030號專利申請案中文申請專利範圍修正本

民國89年10月修正

1 . 一種超純水製造方法, 其特徵係具備,

預先測定試驗處理水之總有機碳濃度與,將此試驗處理水以特定量之紫外線照射後再經離子交換後之試驗處理水的總有機碳濃度,並將前記一連串處理前後之總有機碳濃度的變化量與前記之紫外線照射量之關係製作資料庫之步驟;及

測 定 被 處 理 水 中 之 總 有 機 碳 濃 度 之 步 驟 ; 及

依據所測得之總有機碳濃度及上記資料庫內容來決定照射被處理水的紫外線照射量之步驟;及

以所決定之紫外線照射量照射被處理水而生成第1處理水之步驟;及

對所生成之第1處理水進行離子交換以生成第2處理水之步驟。

2 . 一種超純水製造方法,其特徵係於具備:

以紫外線照射被處理水而生成第 1 處理水之步驟;及 對所生成之第 1 處理水進行離子交換以生成第 2 處理 水之步驟之超純水製造方法中,照射前記被處理水之紫外 線照射量係依據

- (1)被處理水中之總有機碳濃度,與
- (2)第1處理水中之過氧化氫濃度及/或第2處理水中之溶存氧濃度所決定。

埭

六、申請專利範圍

- 3. 如申請專利範圍第1或2項之超純水製造方法, 其中,被處理水中之總有機碳濃度係500ppb以下。
- 4 · 如申請專利範圍第 1 或 2 項之超純水製造方法, 其中,紫外線具有 1 8 0 ~ 1 9 0 n m 之波長。
- 5 · 如申請專利範圍第 1 或 2 項之超純水製造方法, 其中,生成第 2 處理水之步驟中,係具備將第 1 處理水接 觸由離子交換樹脂、離子交換纖維及離子交換膜中所選出 至少一種之部材的步驟。
 - 6 . 一種超純水製造裝置,其特徵係具備:

可預先測定試驗處理水之總有機碳濃度與,將此試驗處理水以特定量之紫外線照射後再經離子交換後之試驗處理水的總有機碳濃度,並將前記一連串處理前後之總有機碳濃度的變化量與前記之紫外線照射量之關係製作資料庫之方法構件;及

測定被處理水中之總有機碳濃度之方法構件;及

依據所測得之總有機碳濃度及上記資料庫內容來決定照射被處理水的紫外線照射量之方法構件;及

以所決定之紫外線照射量照射被處理水而生成第1處理水之過程之方法構件;及

對所生成之第1處理水進行離子交換以生成第2處理水之過程之方法構件。

7. 一種超純水製造裝置,其特徵係具備:

以紫外線照射被處理水而生成第1處理水之方法構件

: 及

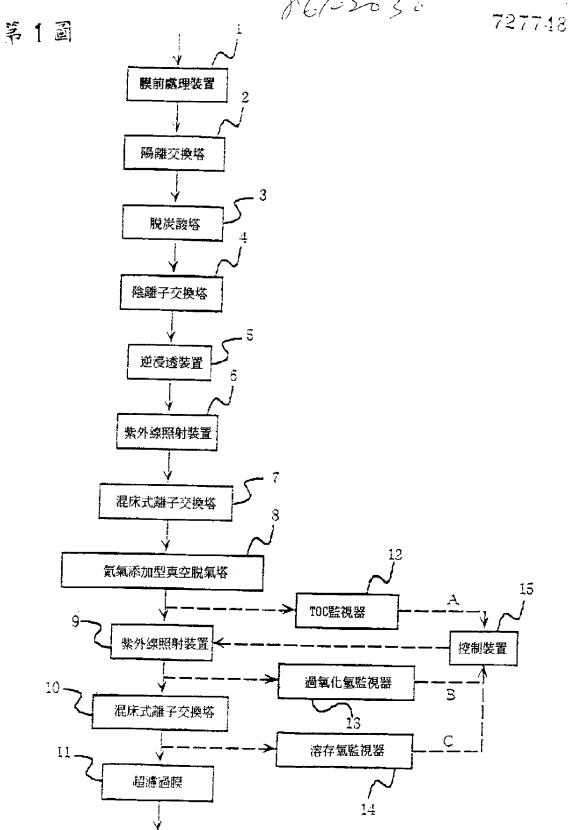
旗

六、申請專利範圍

對所生成之第1處理水進行離子交換以生成第2處理水之方法構件之超純水之製造裝置中,照射前記被處理水之紫外線照射量係依據

- (1)被處理水中之總有機碳濃度,與
- (2)第1處理水中之過氧化氫濃度及/或第2處理水中之溶存氧濃度所決定。
- 8 · 如申請專利範圍第 6 或 7 項之製造裝置,其中, 被處理水中之總有機碳濃度係 5 0 0 p p b 以下。
- 9. 如申請專利範圍第6或7項之製造裝置,其中, 紫外線具有180~190nm之波長。
- 10.如申請專利範圍第6或7項之製造裝置,其生成第2處理水之方法構件中具備有,將第1處理水接觸由離子交換樹脂、離子交換纖維及離子交換膜中所選出至少一種之部材的方法。

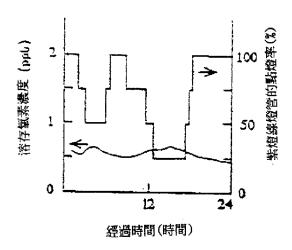
16/02030



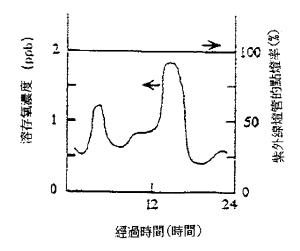
発っる

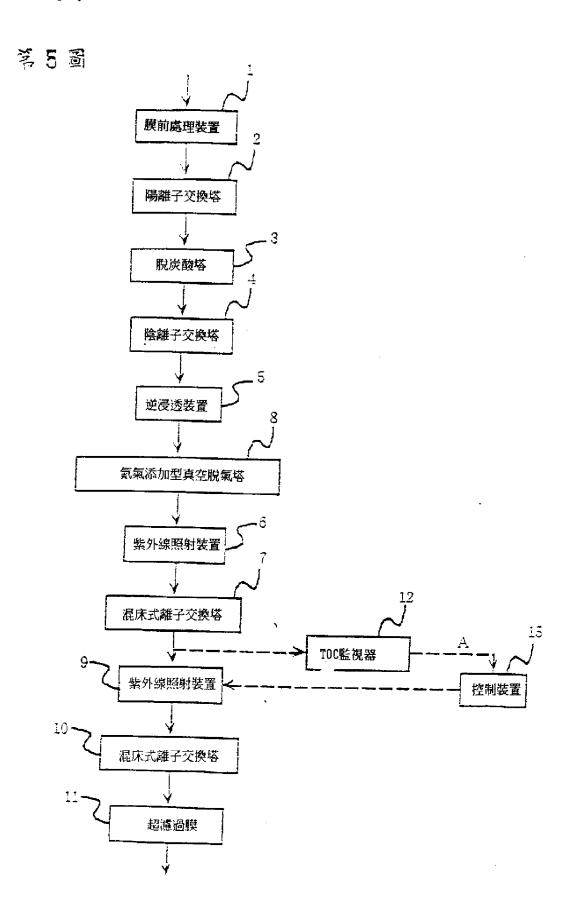
			_	_			_		
	優先順位	e.	:	4]	, 3	c	21	Ľ
	紫外線燈管的點燈狀態	- 2 5		+25	-25	1.95		-25	+ 25
	測定結果	TOC 5ppb以下	100 30以上	7 ppb 以上	過氧化氫濃度 0.0 1 ppm以上	過氧化氫濃度 6 () 分以上 0.0 1 purn 以下		※方代をより、 2 内が、 ※方代を持ち、 2 人が、 2	The property of 以上 O.5 publy 以下
	表號碼	_	61		3	ড়	5	,	Ċ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	震度 死		<i>.</i>					<u>,</u> ပ	

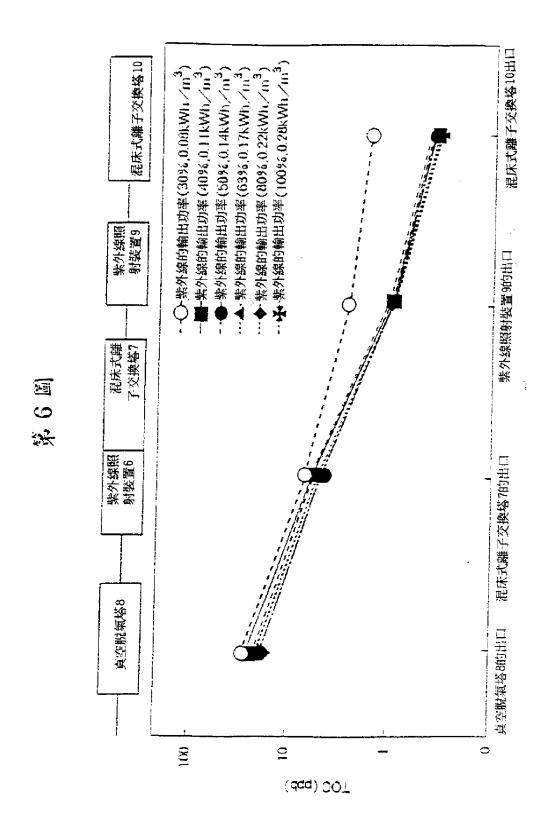
是3圖



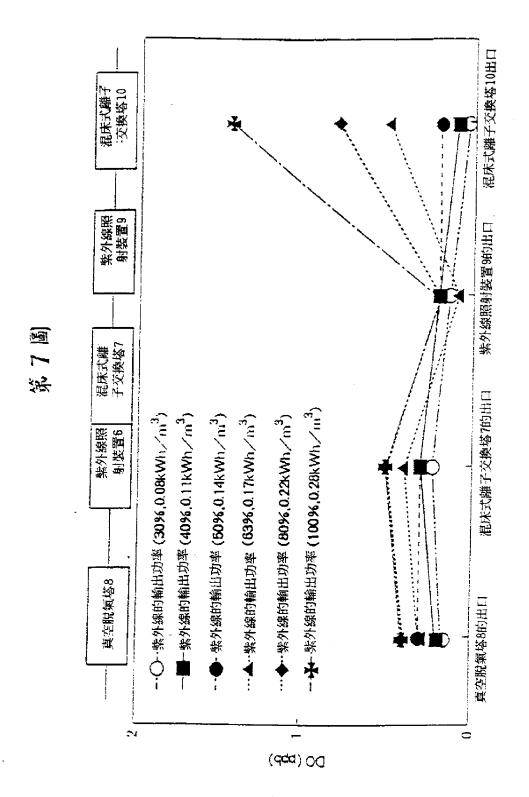
第4圖







5/8

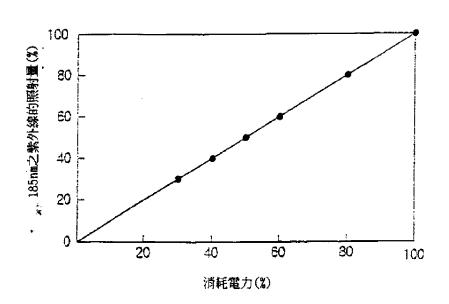


6/8

第8圖

程床式離子交換裝置10的出口之 DO(ms)	0.1~0.2	0.1~0.2	0.1~0.2	0.1~0.2
混床式離子交換装置10的出 口之10C(ppp)	0.7	0.7	0.7	0.7
紫外線的照射量 (kWh/m3)	0.28	0.22	0.17	0.11~0.14
紫外線的 輸出功率 (%)	100	80	63	40~50
紫外線照射装置6的人口 10C(Ppb)	10~15	7~10	5~7	4

第9圖



申請日期 86

第 86102030 號專利申請案

中文說明書修正頁

民國 89 年 10 月修正

申請日期 86 年 2 月 20 日 案 號 86102030 類 別 Cu 2 F 1/3 2 / 42 F AZ

446687

()	以上各欄由	本局填註)	446687
	多	参明 專利 説 明 并型	書
發明	中文	超純水製造方法及超純水製造裝置	
一、	英 文	Method and apparatus for propure water.	oducing ultra
	姓名	(1) 阿部嗣 ② 知野秀一 (3) 中村穣	
、養明 二、 <u>★#</u> #人	國 籍	(1) 日本 ② 日本 (1) 日本國厚木市岡田二-九-八	(3) 日本
	住、居所	② 日本國厚木市岡田二一九一八	
		(3) 日本國厚木市岡田二一九一八	
-	姓 名 (名稱)	(1) 野村微科學股份有限公司 野村マイクロ・サイエンス株式会	≧社
	國籍	(1) 日本	
三、申請人	住、居所 (事務所)	(1) 日本國神奈川縣厚木市岡田二丁目	目九番八號
	代表人姓 名	(1) 佐藤久雄	
	:	• ·	

四、中文發明摘要(發明之名稱:

超純水製造方法及超純水製造裝置本發明係有關一種以紫外線照射被處理水而生成第1處理水,再對第1處理水進行離子交換,以生成第2處理水的超純水製造方法及超純水製造裝置,其中,至少需測定被處理水中的TOC濃度,再依據所測得之結果來決定照射被處理水的紫外線照射量,再以此紫外線照射量照射被處理水的超純水製造方法及超純水製造裝置。

89, 10, 2**3**

英文發明摘奏(發明之名稱:Method and apparatus for producing ultra pure water.

The present method and apparatus for producing ultra pure water comprises the steps of:

irradiating ultraviolet rays to water to be treated to form the first treated water.

performing ion-exchange treatment on the first treated water to form the second treated water.

wherein the quantity of the ultraviolet rays to be irradiated is determined based on the result of measurement of a TOC concentration of the water to be treated."

六、申請專利範圍

第86102030號專利申請案中文申請專利範圍修正本

民國89年10月修正

1 . 一種超純水製造方法, 其特徵係具備,

預先測定試驗處理水之總有機碳濃度與,將此試驗處理水以特定量之紫外線照射後再經離子交換後之試驗處理水的總有機碳濃度,並將前記一連串處理前後之總有機碳濃度的變化量與前記之紫外線照射量之關係製作資料庫之步驟;及

測 定 被 處 理 水 中 之 總 有 機 碳 濃 度 之 步 驟 ; 及

依據所測得之總有機碳濃度及上記資料庫內容來決定照射被處理水的紫外線照射量之步驟;及

以所決定之紫外線照射量照射被處理水而生成第1處理水之步驟;及

對所生成之第 1 處理水進行離子交換以生成第 2 處理水之步驟。

2 . 一種超純水製造方法,其特徵係於具備:

以紫外線照射被處理水而生成第 1 處理水之步驟;及 對所生成之第 1 處理水進行離子交換以生成第 2 處理 水之步驟之超純水製造方法中,照射前記被處理水之紫外 線照射量係依據

- (1)被處理水中之總有機碳濃度,與
- (2)第1處理水中之過氧化氫濃度及/或第2處理水中之溶存氧濃度所決定。